十国源光

第14卷 第8期

用于半导体激光器的柱面扩束系统 Г 值的确定

陈海清

(华中工学院工程光学系)

提要:本文根据衍射理论及高斯光束的特性,推导出柱面扩束系统 Γ 的表达式, 修正和扩展了 Koichi Maseqi^[1]的表达式。

Determination of beam magnification \varGamma of an afocal cylindrical lens for semiconductor lasers

Chen Haigin

(Huazhong Institute of Technology, Wuhan)

Abstract: Based on the diffiraction theory and Gaussian beam characters, the author derived an expression of beam magnification Γ of an afocal cylindrical lens. This expression modifies and expands Koichi Maseqi's expression.



半导体激光器从结构上来说相当于一个 矩形波导式的谐振腔,在其两个互相垂直的 截面方向上,初始点的发散角不同。图1(a) 和(b)表示从半导体激光器发射出来的一束



发散光束的情况,(a)为俯视图(平行接平面 方向),(b)为侧视图(垂直接平面方向)。b 为激光器的象散。因此,要想获得理想的光 斑,必须校正象散,对系统精细调整,手续很 麻烦。

下面研究的光学系统,不需要校正象散, 此系统如图2所示。上为俯视图,下为侧视



. 467 .

图。聚焦透镜 a 由一个物镜 a' 和一个柱面 扩束系统 a'' 组成,柱面扩束系统的母线必须 平行于垂直接平面的方向。

二、柱面扩束系统 Г 值的确定

1. β_⊥放大率

b聚焦物镜衍射受限成象。垂直方向光 束不扩束直接投射到 b 物镜成象,获得经典 的 Airy 衍射 图样。第一个暗环直径 d= 2.44λ•FNO₁。相应于 1/e² 强度值时的直 径为:

 $de=0.675 d=1.64 \lambda \cdot FNO_{\perp}$

对于半导体激光器,单缝衍射的强度分布是 适用的:

$$\sin \theta_{\perp} = \frac{\lambda}{a} \quad a -$$
 \Im

故有 $\beta'_{\perp}=1.64\sin\theta_{\perp} \cdot FNO_{\perp}$ 另外,从几何光学角度考虑, β_{\perp} 的表达式如下:

 $\beta_{\perp} = \frac{nu}{n'u'} = \frac{f'_{2}a}{f'_{1}a} = 2 \operatorname{tg} \theta_{\perp} \cdot FNO_{\perp}$ 比较两者, $\beta_{\perp} > \beta'_{\perp}$, 所以应取 $\beta_{\perp 0}$

2. B。放大率

如图 3 所示, 束腰在 B 点处的高斯光束 在弧矢方向上经过透镜的变换仍然是光束的 束腰在 F' 点, 即:

$$\frac{1}{z_1 - b} + \frac{1}{z_2} = \frac{1}{f_1}$$

假设过 A 点垂直于光轴的平面上光振幅分 布为 $E_0(x_0, y_0)$,入瞳面上的光振幅分布为 $E_1(x_1, y_1)$,象面上的复振幅分布为 $E_2(x_2, y_2)$ 。则:





$$E_{1}(x_{1}, y_{1}) = \frac{e^{ikx_{1}}}{i\lambda z_{1}} e^{\frac{ik}{2z_{1}}(x_{1}^{2}+y_{1}^{2})} \\ \times \left[\int E_{0}(x_{0}, y_{0}) e^{-\frac{ik}{z_{1}}(x_{0}x_{1}+y_{0}y_{1})} dx_{0} dy \right]$$

由上述二维的复振幅分布基尔霍夫衍射公式 不难化为一维形式近似式:

$$E_{1}(x_{1}) = \frac{e^{i(kz_{1}-\frac{\pi}{4})}}{\sqrt{z_{1}\lambda}} \int_{-\infty}^{\infty} E_{0}(x_{0}) e^{ik(x_{0}-x_{1})^{2}/2z_{1}} dx_{0}$$

以由衍射理论可得.

$$E_{2}(x_{2}) = \frac{e^{i\left[k(z_{1}+z_{2})-\frac{x}{2}\right]}}{\lambda\sqrt{z_{1}z_{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} R(x_{1}) E_{0}(x_{0})$$
$$\times e^{ik\left(\frac{x_{0}^{2}}{2z_{1}}+\frac{x_{1}^{2}}{2z_{2}}\right)} e^{ik\left(\frac{x_{1}^{2}}{2z_{1}}+\frac{x_{1}^{2}}{2z_{2}}-\frac{x_{1}^{2}}{2f}\right)}$$

 $\times e^{-ik\left(\frac{x_0x_1}{z_1}+\frac{x_1x_2}{z_2}\right)}dx_0dx_1$

根据该系统的性质与半导体激光器的远场图 形的分布,经处理有:

$$E_{2}(x_{2}) = C \frac{1}{\sqrt{W_{1}}} \int_{-\infty}^{\infty} R(x_{1})$$
$$\times e^{-\frac{x_{1}^{2}}{W_{1}^{2}} - ik \left(\frac{x_{1}^{2}b}{2z_{1}^{2}} + \frac{x_{1}x_{2}}{z^{2}}\right)} dx_{1}$$

式中C为常数, W_1 为光束半径。将 $R(x_1)$ 展开成为无穷区间的函数,由Hermite-Gaussian函数可知.

$$R(x_{1}) = B_{0} N_{0} \frac{1}{\sqrt{W}} e^{-\frac{x_{1}^{2}}{W^{2}}}$$

 B_0 、 N_0 即为 B_n 、 N_n 展开式n=0的项。 B_n 、 N_n 表达式如下.

$$B_{n} = \int_{-\infty}^{\infty} R(x_{1}) \phi_{n}(x_{1}) dx_{1} = \int_{-a}^{a} \phi_{n}(x_{1}) dx_{1}$$
$$N_{n} = \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{2^{n} n!}\right)^{\frac{1}{2}}$$

式中

$$\phi_n(x_1) = \frac{N_n}{\sqrt{W}} H_n\left(\sqrt{2} \frac{x_1}{W}\right) e^{-\frac{x_1^2}{W^2}} o$$

 $H_n(\eta)$ 是 Hermite 函 数, $H_0(\eta) = 1$, $H_1(\eta)$ = 2η , $H_2(\eta) = 4\eta^2 - 2$, $H_3(\eta) = 8\eta^3 - 12\eta_0$ 根据 $R(x_1)$ 的关系式,则有:

$$E_{2}(x_{2}) = C_{1} \frac{1}{\sqrt{W_{1}}}$$
$$\times \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x_{1}^{2}}{W_{2}} - \frac{x_{1}^{2}}{W_{1}^{2}} - 4k \left(\frac{x_{1}^{2}b}{2z_{1}^{2}} + \frac{x_{1}x_{2}}{z_{2}}\right)} dx_{1}$$

 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2 - bx} dx = e^{\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

因为

所以

$$E_{2}(x_{2}) = \frac{C_{2}}{\sqrt{W_{1}}} \sqrt{\frac{\pi}{\left(\frac{1}{W^{2}} + \frac{1}{W_{1}^{2}} + ik\frac{b}{2z_{1}^{2}}\right)}} \\ \times e^{-\frac{1}{4}\left(\frac{1}{W^{2}} + \frac{1}{W_{1}^{2}} + ik\frac{b}{2z_{1}^{2}}\right)^{-1\cdot k^{2}\frac{x_{1}^{2}}{z_{1}^{2}}}}$$

$$E_{2}(0)|_{x=0} = \frac{C_{2}}{\sqrt{W_{1}}} \sqrt{\frac{\pi}{\left(\frac{1}{W_{2}} + \frac{1}{W_{1}^{2}} + ik\frac{b}{2z_{1}^{2}}\right)}} = C_{3} \frac{\sqrt{W_{1}}}{\sqrt{1 + \frac{W_{1}^{2}}{W_{2}} + ik\frac{W_{1}^{2}}{2z_{1}^{2}}b}}$$

式中:
$$\frac{W_1^2}{W^2} = 0.9702 \frac{W_1^2}{a^2}$$

 $\frac{W_1}{z_1} = \sin \theta_{\chi}$

所以

I.

$$E_2(0)|_{a=1}$$

$$=C_{3}\frac{\sqrt{W_{1}}}{\sqrt{1+0.9702\frac{W_{2}^{2}}{a^{2}}+ik\frac{1}{2}b\sin^{2}\theta_{//}}}$$

 θ_{I}

$$=C\frac{W_{1}}{\sqrt{\left(1+0.9702\frac{W_{1}^{2}}{a^{2}}\right)^{2}+k^{2}\frac{1}{4}b^{2}\sin^{4}}}$$
令 t=0.9702 $\frac{W_{1}^{2}}{a^{2}}$,并且将上式对t 求导则
$$\frac{dI_{0}}{dt}=C_{0}\frac{(1+t)^{2}-2t-2t^{2}+4k^{2}b^{2}\sin^{4}\theta}{2t[(1+t)^{2}+4k^{2}b^{2}\sin^{4}\theta_{4}]^{3/2}}$$
令 $\frac{dI_{0}}{dt}=0$,则有:
 $t^{2}=1+4k^{2}b^{2}\sin^{4}\theta_{4}$

$$\mathbb{P} \qquad W_1 = a \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{1}{4}k^2 b^2 \sin^4 \theta_J\right)^{\frac{1}{2}}}{0.9702}}$$

时, Io 将取得最大值。

因为 $\beta_{I} = -\frac{z_2}{z_1}$, 而系统中 $z_2 = f'_2$, $z_1 \sin \theta_{I} \approx W_1$

$$\beta_{I} = -\frac{f'_{2} \sin \theta_{I}}{W}$$
$$= -\frac{2FN\theta_{I} \cdot \sqrt{0.9702} \sin \theta}{\sqrt[4]{1 + \frac{1}{4}k^{2}b^{2} \sin^{4}\theta_{I}}}$$

另外 $\beta_{\perp} = 2 \operatorname{tg} \theta_{\perp} F N O_{\perp}$ 令 $F N O_{\perp} = F N O_{\mu}$, 设投射到 b 成象物镜上 的光束呈圆形光斑,则有:

$$\Gamma = \frac{\beta_{\perp}}{\beta_{\parallel}}$$
$$= \frac{1.015 \operatorname{tg} \theta_{\perp} \cdot \sqrt[4]{1 + \frac{1}{4} k^2 b^2 \sin^2 \theta_{\parallel}}}{\sin \theta_{\parallel}}$$
(1)

上面导出的 Γ 值是扩束系统的最佳值,但没 有考虑 Γ 很大时柱面系统的象差校正问题, 并作了一定近似。当 θ_{\perp} 和 θ_{I} 相差较大时 不适用。

如 *D*_#是满足成象物 镜 衍 射 口 径 需 要 的, 那么有:

$$D_{I} = 2\Gamma \cdot f_1' \sin \theta_{I}$$

因此 Γ 的范围应作如下修改:

$$\frac{D_{\mathscr{I}}}{2f_{1}'\sin\theta_{\mathscr{I}}} \leq \Gamma \leq \frac{1.015 \operatorname{tg} \theta_{\bot} \sqrt[4]{1 + \frac{1}{4}k^{2}b^{2}\sin^{4}\theta_{\mathscr{I}}}}{\sin\theta_{\mathscr{I}}}$$
(2)

D_#为b 成象物镜平行接平面方向上成象光
 束的入射口径, f₁为图 2 中 a' 透镜的焦距。
 当θ_#和b 值较大时, Γ 的范围 还应修改。
 (下转第 463 页)

. 469 .

 $O_2(^{1}\Delta)$ -CH₃I-N₂体系已高于 160 mJ 激光输出, $O_2(^{1}\Delta)$ 能量利用效率为 12%。

2. RI/O2 比值和总压对激光脉宽的影响

由图4还可看到,在总压为2Torr以下 CH₃I/O₂=0.2时,激光脉冲的半宽度 (FWHM)长达110 μ s以上,甚至最高可达130 μ s(图中未列出)。与此同时闪光灯脉冲半宽只有15 μ s左右。这说明发生了较好的链循环,估计其效果比碘分子高得多。随着CH₃I/O₂比值或总压的提高,激光脉宽成反比缩短。有意思的是在低压下提高 RI/O₂比 值对激光脉宽稍有缩短影响,说明我们选用的碘化物(CH₃I和 CF₃I)还不是很理想。虽然其对 I*(²P_{1/2})的猝灭,程度上可能有所好转但还不够,这类碘化物尚能 稍微 引起对I*(²P_{1/2})猝灭的各种复杂副反应。

3. 0₂(¹Δ)-CH₃I-N₂ 与 0₂(¹Δ)-CF₃I
 -N₂ 体系的比较

图5显示两体系在激光能量输出方面的 对比。两组数据是在工作总压、总氧分压、 O₂(¹d)分压、闪光灯工作电压基本保持不变 的条件下,只改变 RI分压进行试验的。由 图可见,O₂(¹d)-CH₃I-N₂体系要比O₂(¹d)-CF₃I-N₂为佳。激光能量前者约为后者的2 倍,相应化学效率也为后者的2倍。低 RI 分 压下,两者相差更多,甚至达4~5倍。激光

(上接第469页)

三、设 计 题 例

半导体激光器波长 λ=800 nm, 采用单 模式,其参数如下:

 $\theta_{\perp} = 30^{\circ}, \theta_{\parallel} = 5^{\circ}, b = 10 \,\mu \mathrm{m}_{\circ}$

考虑到工作距不至太小,选取 f'= 8mm,入射口径 D 取 8mm。由上述条件直 接代入(2)式计算可得:

$4.25 \leq \Gamma \leq 6$

考虑到仪器结构的大小及象差校正需要,取

能量随 RI 分压的增加而增加,最终达到极 大值后下降。两者在激光性能上有如此大的 差别,只在于 R 基不同。表明激光性能与所 使用碘化物的分子结构密切有关。清楚地说 明氟烷基团的存在,可能引起有害于氧碘传 能反应以及对 I*(²P_{1/2}) 猝灭的各类副反应。 而氢甲基基团的存在,此类副反应就不如氟 烷基团明显,运转效率较高。以上激光试验 结果与文献[5]的基础研究结果颇为吻合。因 此进一步开展各类碘化物对激光性能(包括 能量输出和脉宽等性能)影响的研究是很有 必要的。

参加本实验工作的还有许庆洲、桓长清、 黄瑞平、桑凤亭、董子丰、张允禄、国保川、邵 明君、杨何平同志。此外尚有沈惠华、刘惠芳、 王宗娟、孙以珠、闵祥德、李明盛同志参加部 分工作,谨此表示感谢。

参考文献

- [1] A W & S T, 1982, 117, No. 13, 16; Defense Electronics, 1983, 15, No. 11, 11.
- [2] Gas Flow and Chemical Lasers 1984, edited by
 A. S. Kaye, (Adam Hilger Ltd, Bristol and Boston). pp. 137~206.
- [3] G. A. Fisk, G. N. Hays; Chem. Phys. Lett., 1981,79, 331.
- [4] J. Donovan et al.; Transactioon of the Far. Soc., 1966, 62, 2023.
- [5] A. T. Young, P. L. Houston; J. Chem. Phys., 1983, 78, 2317.

下限,确定扩束系统的 Γ ,即 $\Gamma=4.5$

扩束系统是一个倒置的伽里略望远镜系统。为了降低加工成本,采用平凸和平凹两透镜组成,接近球差最优化型式。两柱面镜的材料选取有其特殊性:负柱面镜取为冕牌玻璃 k₉,正柱面镜选取火石玻璃 ZF₇,这样 有利于象差的平衡。

参考文献

[1] U.S.P., 4, 253. 735.